



РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 2024/2025 навчальний рік, прийому студентів 2024 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи
Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО
" " 2024 р.

Спеціальність 132 Матеріалознавство
Освітня програма Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів
Освітній ступінь магістра
Випускова кафедра Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Факультет/ІНІ
Форма здобуття вищої освіти
Строк навчання
Кваліфікація

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона
Заоч.
1 рік 4 місяці
Магістр з матеріалознавства

№ п/п	Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практи., кваліф. роб.)	Кафедра	К-ть здобув.		Обсяг дисциплін		Аудиторні години							СРС	Контрольні заходи							Розподіл аудиторних годин на тиждень за курсами і семестрами												
			Бюджет	Контракт	Кред. ECTS	Години	Всього	Лекції		Практ. (комп. прк)	Лабор	Інд. зан.	Екзамен		Заліки	МКР	Курсові роботи	Курсові проекти	РГР, РР, ГР	ДКР	Реф.	1 курс			2 семестр									
								за НП	з урах. Інд занять													за НП	з урах. Інд занять	за НП	з урах. Інд занять	Всього	у т.ч.	у т.ч.	у т.ч.	у т.ч.	у т.ч.			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ																																		
Цикл загальної підготовки																																		
1	Інтелектуальна власність та патентознавство (модуль Патентознавство та набуття прав)	КВПП	5	0	2.0	60	10	4	-	6	-	-	-	0	50	1	1										10	4	6					
2	Інтелектуальна власність та патентознавство (модуль Право інтелектуальної власності)	КМ	5	0	1.0	30	4	2	-	2	-	-	-	0	26												4	2	2					
3	Основи інженерії та технології сталого розвитку	ШІ	5	0	2.0	60	8	4	-	4	-	-	-	0	52	1	1										8	4	4					
4	Педагогіка вищої школи	ПП	5	0	2.0	60	8	4	-	4	-	-	-	0	52	1	1										8	4	4					
5	Менеджмент стартап-проектів	МП	5	0	3.0	90	10	4	-	6	-	-	-	0	80	2	2												10	4	6			
6	Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації	АМТС1	5	0	3	90	12	-	-	12	-	-	-	0	78	2	1							1	6		6		6		6			
Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки					13	390	52	18	0	34	0	0	0	0	338	0	5	5	0	0	0	0	1	36	14	22	0	16	4	12	0			
Цикл професійної підготовки																																		
7	Інженерне матеріалознавство. Частина 1	ВМПМ	5	0	5.0	150	22	14	-	8	-	-	-	0	128	1	1						1	22	14	8								
8	Інженерне матеріалознавство. Частина 2	ВМПМ	5	0	3.0	90	14	6	-	4	-	4	-	0	76	2												14	6	4	4			
9	Інженерне матеріалознавство. Курсова робота	ВМПМ	5	0	1.0	30	0	-	-	-	-	-	-	0	30	2	2																	
10	Фізика міцності і руйнування	ВМПМ	5	0	4.0	120	16	10	-	-	-	6	-	0	104	1	1									16	10	6						
11	Вибір і комп'ютерний дизайн матеріалів	ВМПМ	5	0	4.0	120	18	8	-	-	-	10	-	0	102	1	1									18	8	10						
12	Фундаментальні засади теорії та технології порошкових і композиційних матеріалів	ВМПМ	5	0	5.0	150	18	10	-	-	-	8	-	0	132	1	1									18	10	8						
13	Наукові основи створення наноматеріалів	ВМПМ	5	0	4.0	120	18	14	-	-	-	4	-	0	102	1	1									18	14	4						
Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки					26	780	106	62	0	12	0	32	0	0	674	2	5	5	1	0	0	0	1	92	56	8	28	14	6	4	4			
ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ					39	1170	158	80	0	46	0	32	0	0	1012	2	10	10	1	0	0	0	2	128	70	30	28	30	10	16	4			
2. ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ																																		
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Ф-каталогів																																		
14	Електронно-зондові методи аналізу речовин та матеріалів	ВМПМ	5	0	5.0	150	16	10	-	-	-	6	-	0	134	2	2											16	10		6			
15	Мікроскопія і адсорбційний аналіз наносистем	ВМПМ	0	0	5.0	150	16	10	-	-	-	6	-	0	134	2	2											16	10		6			
16	Магнітні та електротехнічні порошкові матеріали	ВМПМ	0	0	5.0	150	16	10	-	-	-	6	-	0	134	2	2											16	10		6			
17	Рентгенівський аналіз дисперсних матеріалів	ВМПМ	5	0	5.0	150	16	10	-	-	-	6	-	0	134	2	2											16	10		6			
18	Дифракційні методи дослідження наноматеріалів	ВМПМ	0	0	5.0	150	16	10	-	-	-	6	-	0	134	2	2											16	10		6			
19	Матеріали паливних комірок	ВМПМ	0	0	5.0	150	16	10	-	-	-	6	-	0	134	2	2											16	10		6			
20	Надтверді матеріали та тверді сплави	ВМПМ	5	0	4.0	120	16	10	-	6	-	-	-	0	104	2	2											16	10		6			
21	Порошкові та композиційні матеріали для медицини	ВМПМ	0	0	4.0	120	16	10	-	6	-	-	-	0	104	2	2											16	10		6			
22	Сучасні технології 3D друку	ВМПМ	0	0	4.0	120	16	10	-	6	-	-	-	0	104	2	2											16	10		6			
23	Фізика і хімія наносистем	ВМПМ	5	0	5.0	150	16	10	-	6	-	-	-	0	134	2	2											16	10		6			
24	Дисперсні системи та поверхневі явища	ВМПМ	0	0	5.0	150	16	10	-	6	-	-	-	0	134	2	2											16	10		6			
25	Атомістична інформатика матеріалів	ВМПМ	0	0	5.0	150	16	10	-	6	-	-	-	0	134	2	2											16	10		6			
26	Теорія і технологія нанопокриттів	ВМПМ	5	0	4.0	120	16	10	-	-	-	6	-	0	104	2	2											16	10		6			
27	Фрактодіагностика руйнування матеріалів	ВМПМ	0	0	4.0	120	16	10	-	-	-	6	-	0	104	2	2											16	10		6			
28	Основи планування багатофакторного експеримента	ВМПМ	0	0	4.0	120	16	10	-	-	-	6	-	0	104	2	2											16	10		6			
Разом вибірових ОК циклу професійної підготовки					23	690	80	50	0	12	0	18	0	0	610	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	50	12	18		
ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ					23	690	80	50	0	12	0	18	0	0	610	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	50	12	18		
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:					62	1860	238	130	0	58	0	50	0	0	1622	5	12	15	1	0	0	0	2	128	70	30	28	110	60	28	22			
																Кількість екзаменів		5		2		3												
																Кількість заліків		12				6		6										
																МКР		15				9		6										
																Курсових робіт		1						1										
																Курсових проектів		0																
																РГР, РР, ГР		0																
																ДКР		0																
																Рефератів		2				2												

* МКР виконується за методикою домашньої контрольної роботи

Ухвалено на засіданні Вченої ради ННІМЗ ПРОТОКОЛ № _____ від _____

Завідувач кафедри ВМПМ _____

Юрій БОГОМОЛ
(підпис)

Декан факультету (директор інституту) _____

Ігор ВЛАДИМИРСЬКИЙ
(підпис)

Примітка: РНП є частиною навчального плану і формується на основі аналізу сукупності індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на поточний навчальний рік;